

## Формулы для оценки параметров положительного столба тлеющего разряда в электроотрицательных газах при конечных ионных температурах

© А.П. Головицкий

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,  
195251 Санкт-Петербург, Россия  
e-mail: alexandergolovitski@yahoo.com

(Поступило в Редакцию 19 июня 2013 г.)

В простейшем предположении о постоянстве скоростей плазмохимических процессов на примере плазмы положительного столба электроотрицательного разряда низкого и среднего давлений для случая отлипания нейтральными частицами получены явные, достаточно простые и в то же время приемлемо точные аналитические соотношения, позволяющие быстро оценить геометрические параметры пространственных распределений концентраций заряженных частиц в названной плазме, а также ее энергетические параметры, не прибегая к численному моделированию. Новым является учет конечности ионных температур и наличия ионной диффузии. Показано, что поперечное расслоение электроотрицательной плазмы на области с разным ионным составом является следствием неизотермичности плазмы.

### Введение

Перенос заряженных частиц в низкотемпературной плазме положительного столба (ПС) электроотрицательных (ЭО) газов обладает рядом существенных особенностей. В первую очередь это связано с тем обстоятельством, что поперечное к протеканию тока самосогласованное электрическое поле  $E_x$ , вызванное уходом электронов на стенку при  $T_e > T_i$ , втягивает отрицательные ионы вглубь плазмы. Поэтому плазма ПС расслаивается на области с разным ионным составом. Ее периферийная область практически не содержит отрицательных ионов и представляет собой электрон-ионную ( $e-i$ ) плазму, для которой характерен близкий к амбиполярному режим диффузии плазмы и наличие поперечного электрического поля  $E_x$ , направленного наружу. Во внутренней же области (объеме плазмы) концентрации ионов — и отрицательных  $n_n$ , и положительных  $n_p$  — намного превышают концентрацию электронов  $n_e$ , т.е. плазму можно назвать ионной ( $i-i$ ). В объеме при сильной электроотрицательности имеет место близкая к свободной диффузия электронов при почти плоском пространственном распределении их концентрации; величина последней намного меньше, чем  $n_p$  и  $n_n$ , а поперечное поле  $E_x$  близко к нулю. В узкой области перехода от  $i-i$  к  $e-i$ -плазме имеют место сильные изменения концентраций ионов [1–6].

Изложенные результаты в основном получены посредством сложного численного моделирования плазмы. Современные модели способны обеспечить даже количественную точность в сопоставлении с данными эксперимента. Но при их практическом применении часто возникает необходимость приспособлять модель к изменениям условий эксперимента и выявлять доминирующие элементарные процессы в плазме, что

непросто сделать без априорного знания параметров плазмы, которые еще только подлежат вычислению в составляемой модели.

Приведенные в [1,7–9] простые аналитические соотношения позволяют легко и, как показано в [7], с приемлемой точностью априори оценить параметры пространственных распределений концентраций заряженных частиц и энергетические параметры плазмы ПС ЭО тлеющего разряда низкого и среднего давлений, не прибегая к численному моделированию. Но все названные соотношения были получены лишь для случая, когда отношение ионной и электронной температур  $\tau = T_i/T_e \rightarrow 0$ , т.е. в пренебрежении ионной диффузией, что ограничивает область их применения. В то же время, как показано при численном моделировании реального разряда в кислороде [9], величина  $\tau$  может достигать  $\sim 0.15$ – $0.2$ ; при этом и формы профилей концентраций заряженных частиц, и толщина периферийной области существенно отличаются от случая, когда  $\tau \rightarrow 0$ . Тем не менее аналитических соотношений, сопоставимых по простоте и точности с приведенными в [7–9], но в которых учитывалось бы, что  $\tau > 0$ , пока не получено.

Целью настоящей работы является развитие результатов [7], т.е. получение, по-возможности, простых аналитических соотношений, позволяющих и в случае заметного влияния ионной диффузии с приемлемой точностью оценить параметры пространственных распределений концентраций заряженных частиц в плазме ПС тлеющего разряда низкого и среднего давлений в ЭО газах, а также энергетические параметры названной плазмы без сложного численного моделирования.

### Исходные предположки

Как и в [7], будем полагать отлипание электронов основным механизмом гибели отрицательных ионов — как для разрядов, содержащих кислород. Исходная стационарная система для поперечных потоков заряженных частиц  $\Gamma_j$  и их дивергенций имеет вид

$$\begin{cases} \nabla\Gamma_e = (v_i - v_a)n_e + v_d n_n, \\ \nabla\Gamma_p = v_i n_e, \\ \nabla\Gamma_n = v_a n_e - v_d n_n, \end{cases} \quad (1)$$

$$\Gamma_j = -D_j \nabla n_j + z_j n_j \mu_j E_x, \quad (2)$$

$$\Gamma_p - \Gamma_n - \Gamma_e = 0. \quad (3)$$

Граничные условия задачи:

$$n_e(x_W) = n_p(x_W) = n_n(x_W) = 0, \quad \Gamma_n(x_W) = 0.$$

Здесь  $x_W$  — координата стенки,  $D_j, \mu_j, z_j$  — коэффициенты диффузии, подвижности и знаки заряда частиц  $j$ -го сорта, индексы  $e, p, n$  соответствуют электронам, положительным и отрицательным ионам,  $v_i, v_a, v_d$  — частоты ионизации, прилипания и отлипания. Указанные коэффициенты и частоты в реальности определяются продольным электрическим полем  $E_z$ , являющимся собственным числом задачи. В излагаемой здесь простой 1D модели принято, что собственным числом является частота ионизации  $v_i$ , а  $v_a, v_d, D_j, \mu_j$  являются заданными константами. Рассмотрим случай неизотермичной плазмы  $T_e > T_i$ , а также допустим, что  $\mu_e n_e \gg \mu_p n_p, \mu_n n_n$ .

Введем безразмерную координату  $X = x/x_W$ , приведенные диффузионные частоты  $D_{aj}^* = \mu_j T_e / (e x_W^2)$ , а также приведенные безразмерные частоты ионизации  $\nu = v_i / D_{ap}^*$ , прилипания  $\alpha = v_a / D_{an}^*$  и отлипания  $\beta = v_d / D_{an}^*$ . Нормируем концентрации заряженных частиц на  $n_{e0}$  — электронную концентрацию в центре плазмы — и введем обозначения:  $n = n_e / n_{e0}, N = n_n / n_{e0}, P = n_p / n_{e0}, \tau_j = T_j / T_e$ . Тогда из (1)–(3) с учетом квазинейтральности плазмы можно получить

$$-\Delta N \tau_n + \nabla \left( \frac{N}{n} \nabla n \right) = \alpha n - \beta N, \quad (4)$$

$$-\Delta P \tau_p - \nabla \left( \frac{P}{n} \nabla n \right) = \nu n, \quad (5)$$

где аргументом является безразмерная координата  $0 \leq X \leq 1$ .

Полученные при  $\tau_{p,n} \rightarrow 0$  основные результаты [7] сводятся к следующему. Во внешней области (оболочке) при  $1 - \delta < X \leq 1$  электроны распределены как

$$n(X) \approx n_1 \sin \left[ \frac{\pi}{2\delta} (1 - X) \right], \quad (6)$$

где  $\delta$  — толщина оболочки:

$$\delta \cong \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{\nu + \alpha}}, \quad \text{при } \alpha \gg 1 \quad \delta \approx \pi / (2\sqrt{\alpha}), \quad (7)$$

а величина  $n_1 = n(1 - \delta)$  определяется из условия сшивки  $n(X)$  на границе оболочка–объем. В оболочке мало отрицательных ионов:  $N \ll n$ .

В центральной области (объеме) плазмы электронные профили

$$n(X) \approx \cos \left( \sqrt{\frac{\nu\beta}{\nu + \alpha}} X \right)$$

или

$$n(X) \approx J_0 \left( \sqrt{\frac{\nu\beta}{\nu + \alpha}} X \right) \quad (8)$$

для плоской (ПГ) и цилиндрической геометрий (ЦГ) соответственно. Ионные профили в объеме подобны профилям электронов

$$n(X) \approx N_0 \cos \left( \sqrt{\frac{\nu\beta}{\nu + \alpha}} X \right) \quad (\text{ПГ})$$

или

$$n(X) \approx N_0 J_0 \left( \sqrt{\frac{\nu\beta}{\nu + \alpha}} X \right) \quad (\text{ЦГ}), \quad (9)$$

где отношение концентраций отрицательных ионов и электронов в центре разряда

$$N_0 = N(0) \approx \frac{\nu + \alpha}{\beta}. \quad (10)$$

Критерий работоспособности вышеприведенных формул

$$\tau < 0.2\beta/\alpha \quad (11)$$

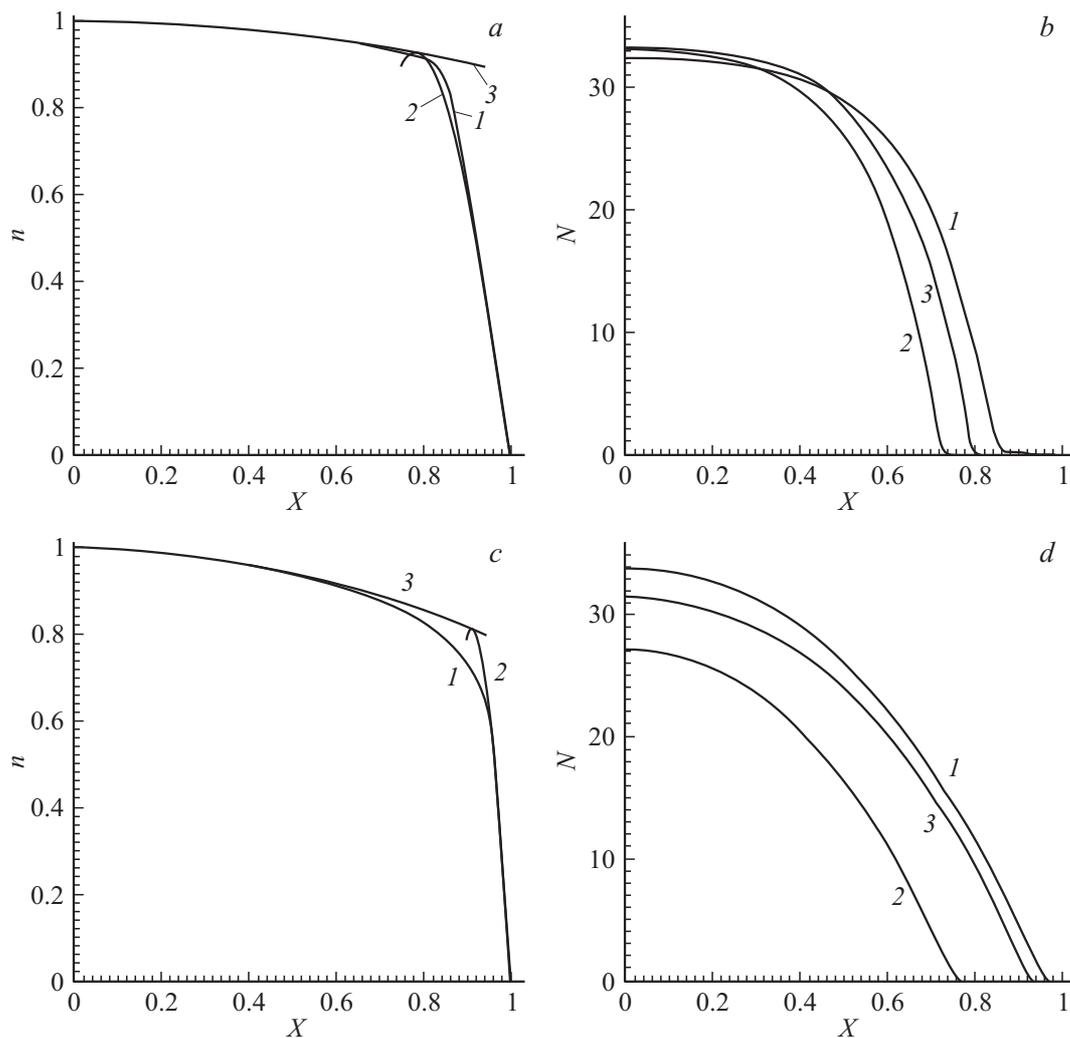
получен в [7] из условия малости определяемой отлипанием приведенной диффузионной длины отрицательных ионов  $\lambda = \frac{\sqrt{D_n/v_d}}{x_W} = \sqrt{\tau/\beta}$  по сравнению с  $\delta$ .

В настоящей работе ограничимся случаем сильной электроотрицательности  $\alpha \gg 1$  и  $\alpha \gg \beta$ , когда влияние ионной диффузии, как следует из (11), сказывается наиболее существенно, а внешняя оболочка  $e$ - $i$ -плазмы настолько тонкая, что ее и в ЦГ можно положить плоской, т.е.  $\delta \ll 1$ . Для этого случая (точнее для  $\beta \leq 2\sqrt{\alpha}$ ) в [1,7,8] приведены следующие выражения для приведенной частоты ионизации:

$$\nu \approx \sqrt{\alpha} \quad (\text{ПГ}) \quad \text{или} \quad \nu \approx 2\sqrt{\alpha} \quad (\text{ЦГ}). \quad (12)$$

Далее для простоты примем  $\tau_p = \tau_n = \tau = T_i/T_e$ .

Правомерность сделанных в работе предположений, а также точность полученных в итоге аналитических соотношений будут продемонстрированы ниже путем сравнения последних с результатами так называемого „вычислительного эксперимента“, т.е. численного решения уравнений (1)–(3). Эти уравнения были преобразованы в задачу на собственные значения, в качестве которых были избраны отношение концентраций отрицательных ионов и электронов в центре разряда  $N_0$  и приведенная частота ионизации  $\nu$ . Детально „вычислительный эксперимент“ описан в [7].



**Рис. 1.** Влияние конечной ионной температуры на профили концентраций заряженных частиц для плоской геометрии при  $\alpha = 25$ ,  $\beta = 1$ : *a* — электроны,  $\tau = 0.01$ , 1 — численный расчет, 2 — формула (6) при  $\delta_r$  по (18), 3 — формула (8); *b* — отрицательные ионы,  $\tau = 0.01$ , 1 — численный расчет, 2 —  $N(X)$  по (14) при  $\delta$  по (7), 3 —  $N(X)$  по (14) при  $\delta_r$  по (18); *c, d* — то же, что и *a, b*, но при  $\tau = 0.1$ ; величины  $\nu$  рассчитаны по (20).

## Профили концентраций заряженных частиц

При  $\alpha \gg 1$  в объеме будет  $N \approx P \gg n$  [1,7-9], учтя это и сложив (4) и (5), получим

$$-2\tau \Delta N \approx (\alpha + \nu)n - \beta N. \quad (13)$$

Допустим, что ионная диффузия мало влияет на профиль концентрации электронов в объеме и примем, что для  $n(X)$  будет по-прежнему выполняться (8). Численное моделирование подтверждает данное допущение — рис. 1, *a, b*. Тогда (13) имеет следующее аналитическое решение:

$$N(X) \approx \frac{\nu + \alpha}{\beta[1 + 2\tau\nu/(\nu + \alpha)]} \times \left\{ \cos(\xi X) - \frac{\cos[\xi(1 - \delta_r)]}{\text{ch}[(1 - \delta_r)/(\lambda\sqrt{2})]} \text{ch}[X/(\lambda\sqrt{2})] \right\}, \quad (14)$$

$$N(X) \approx \frac{\nu + \alpha}{\beta[1 + 2\tau\nu/(\nu + \alpha)]} \times \left\{ J_0(\xi X) - \frac{J_0[\xi(1 - \delta_r)]}{I_0[(1 - \delta_r)/(\lambda\sqrt{2})]} I_0[X/(\lambda\sqrt{2})] \right\}, \quad (15)$$

для ПГ и ЦГ соответственно. Здесь  $J_0$  и  $I_0$  — обычная и модифицированная функции Бесселя нулевого порядка,  $\xi = \sqrt{\nu\beta/(\nu + \alpha)}$ , а величина  $\delta_r$  — такое расстояние от стенки, где  $N(1 - \delta_r)$  можно положить равной нулю (см. рис. 1, *b, d*, кривые 1).

Для величины  $N_0 = N(0)$  при  $\alpha \gg \nu\tau$  можно принять

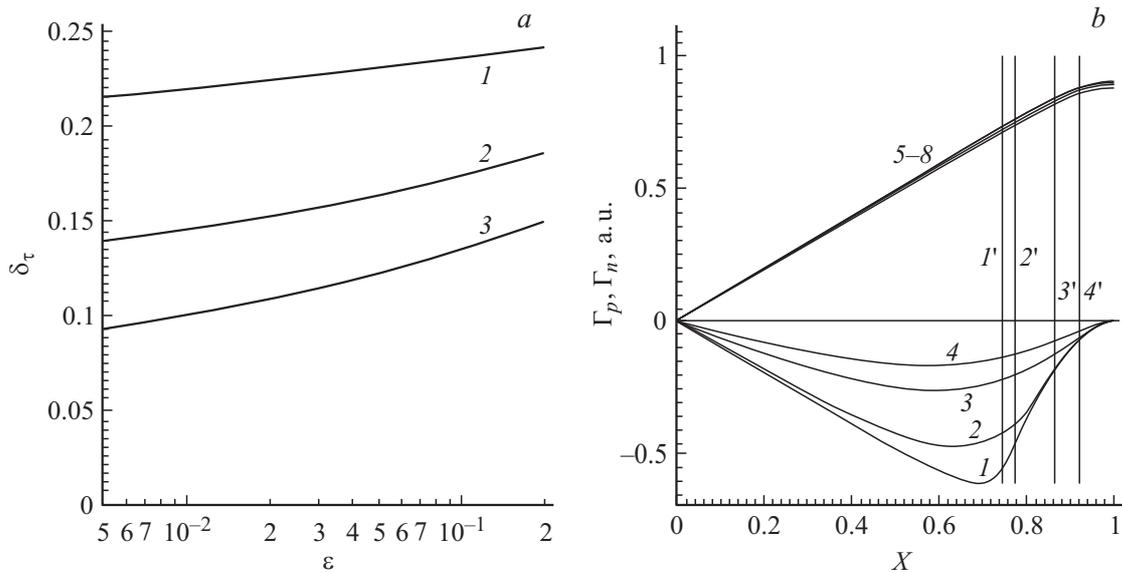
$$N_0 \approx \left( \frac{\nu + \alpha}{\beta} - 2\nu\lambda^2 \right) f(\lambda), \quad (16)$$

где множитель  $f(\lambda)$  при  $\lambda \leq 0.4$  примерно равен

$$f(\lambda) \approx 1 - 2 \exp[-1/(\lambda\sqrt{2})] \text{ для ПГ}$$

и

$$f(\lambda) \approx 1 - \sqrt{\sqrt{2}\pi/\lambda} \exp[-1/(\lambda\sqrt{2})] \text{ для ЦГ.}$$



**Рис. 2.** Влияние конечной ионной температуры на толщину „оболочки“ и на ионные потоки для плоской геометрии при  $\alpha = 25$ ,  $\beta = 1$  („вычислительный эксперимент“: численное решение уравнений (1)–(3)): *a* — зависимости  $\delta_\tau(\epsilon) = 0.01$ ; 2 —  $\tau = 0.05$ ; 3 —  $\tau = 0.1$ ; *b* — потоки ионов, 1 —  $\Gamma_n$  при  $\tau = 0.001$ ; 2 —  $\Gamma_n$  при  $\tau = 0.01$ ; 3 —  $\Gamma_n$  при  $\tau = 0.05$ ; 4 —  $\Gamma_n$  при  $\tau = 0.1$ ; 5–8 — то же, что и 1–4 для  $\Gamma_p$ ; вертикальными линиями 1'–4' показано рассчитанное по (18) положение границы раздела *i-i*- и *e-i*-плазм при тех же  $\tau$ , что и для 1–4 соответственно.

При  $\tau \rightarrow 0$  (14) и (15) переходят в (9), а (16) — в (10). Для ПГ при  $\lambda < 0.25$ , а для ЦГ при  $\lambda < 0.18$  можно положить  $f(\lambda) \approx 1$ , и тогда (16) упрощается

$$N_0 \approx \frac{\nu + \alpha}{\beta} - 2\nu\lambda^2. \quad (17)$$

Результаты сложных численных моделей [5,6,9] демонстрируют, что наличие ионной диффузии приводит к частичному проникновению отрицательных ионов со стороны объема в оболочку, к сокращению размера обедненной отрицательными ионами пристеночной области *e-i*-плазмы; т.е. при  $\tau > 0$  величина  $\delta_\tau$  должна быть меньше, чем  $\delta$ , рассчитанная при  $\tau \rightarrow 0$  по (7). Если все же в качестве  $\delta_\tau$  подставить  $\delta$  из (7), то (14) и (15) не дают приемлемого согласия с данными „численного эксперимента“ даже при сравнительно небольших  $\tau$  (например, для  $\alpha = 25$ ,  $\beta = 1$  уже при  $\tau \geq 0.01$  (рис. 1, *b, d*, кривые 2)).

Оценим величину  $\delta_\tau$ . Диффузионный поток отрицательных ионов направлен к стенке против силы, создаваемой поперечным полем  $E_x$ , сосредоточенным в пристеночной оболочке *e-i*-плазмы. В первом приближении

$$E_x(X) \approx \frac{T_e}{ex_W} \sqrt{\nu + \alpha} \operatorname{ctg}[\sqrt{\nu + \alpha}(1 - X)].$$

В координате  $Z$ , отсчитываемой от границы оболочки  $X_0 = 1 - \delta$  к стенке, потенциальная энергия иона

$$\begin{aligned} W_n(Z) &\approx T_e \sqrt{\nu + \alpha} \int_0^Z \operatorname{tg}(\xi \sqrt{\nu + \alpha}) d\xi \\ &= -T_e \ln[\cos(Z\sqrt{\nu + \alpha})]. \end{aligned}$$

Концентрация отрицательных ионов в поле  $E_x$  распределена по Больцману

$$\frac{N(Z)}{N|_{Z=0}} = \exp\left[-\frac{W_n(Z)}{T_n}\right] = [\cos(Z\sqrt{\nu + \alpha})]^{1/\tau}.$$

Положим границей диффузионного продвижения отрицательных ионов к стенке такую координату  $Z = \delta_D$ , при которой  $\frac{N(\delta_D)}{N|_{Z=0}}$  сделается малой величиной  $\epsilon \ll 1$ . Анализ показал, что конечный результат, т.е. величина  $\delta_\tau$ , весьма слабо зависит от  $\epsilon$  в пределах от 0.005 до 0.2 (рис. 2, *a*). Это дает возможность принять  $\epsilon = 0.005$ , т.е.  $\frac{N(\delta_D)}{N|_{Z=0}} = \frac{1}{200}$ , а  $\delta_D \approx \frac{\arccos(0.005^\tau)}{\sqrt{\nu + \alpha}}$ . Итоговая толщина обедненной отрицательными ионами внешней оболочки  $\delta_\tau$  при  $\tau > 0$

$$\delta_\tau \approx \delta - \delta_D = \frac{\pi}{2} \frac{1}{\sqrt{\nu + \alpha}} \left[ 1 - \frac{2}{\pi \arccos(0.005^\tau)} \right]. \quad (18)$$

При  $\tau \rightarrow 0$  толщина оболочки  $\delta_\tau$  стремится к величине  $\delta$ , даваемой формулой (7), а при  $\tau \rightarrow 1$   $\delta_\tau \rightarrow 0$ . Это подтверждает гипотезу [1] о том, что физической причиной расслоения многокомпонентной плазмы и наличия в ней периферийной области, не содержащей отрицательных ионов, является неизотермичность плазмы. При  $T_e \gg T_i$  сильное электрическое поле  $E_x$ , вызванное диффузионным уходом электронов из периферийной области на стенку, уносит отрицательные ионы с периферии в объем и создает потенциальный барьер, преодолеть который отрицательные ионы при диффузионном движении к стенке не могут.

При  $\tau > 0$  рассчитываемую из (18) величину  $\delta_\tau$  следует подставлять в (14), (15) и в (6) (в последнем

Геометрия	$\alpha$	$\beta$	$\tau$	$\sqrt{\alpha}$	$\nu_{\text{num}}$	$\nu$ по (20)	$N_{0,\text{num}}$	$N_0$ по (17)	$N_0$ по (16)
ПГ	25	1	0.001	<b>5.0</b>	<b>6.1</b>	<b>6.0</b>	<b>31.0</b>	<b>30.0</b>	<b>30.0</b>
ПГ	25	1	0.01	5.0	<b>7.6</b>	<b>8.3</b>	<b>32.1</b>	<b>33.1</b>	<b>33.0</b>
ПГ	25	1	0.05	5.0	<b>13.7</b>	<b>13.3</b>	<b>33.6</b>	<b>36.9</b>	<b>33.8</b>
ПГ	25	1	0.1	5.0	<b>20.7</b>	<b>17.3</b>	<b>33.5</b>	<b>38.8</b>	<b>30.6</b>
ПГ	90	3	0.001	<b>9.5</b>	<b>10.1</b>	<b>11.5</b>	<b>33.3</b>	<b>33.8</b>	<b>33.8</b>
ПГ	90	3	0.01	<b>9.5</b>	<b>12.6</b>	<b>15.6</b>	<b>34.0</b>	<b>35.1</b>	<b>35.0</b>
ПГ	90	3	0.05	9.5	<b>21.0</b>	<b>23.9</b>	<b>35.9</b>	<b>37.2</b>	<b>36.9</b>
ПГ	90	3	0.1	9.5	<b>29.5</b>	<b>30.4</b>	<b>36.6</b>	<b>38.1</b>	<b>36.5</b>
Геометрия	$\alpha$	$\beta$	$\tau$	$2\sqrt{\alpha}$	$\nu_{\text{num}}$	$\nu$ по (21)	$N_{0,\text{num}}$	$N_0$ по (17)	$N_0$ по (16)
ЦГ	25	1	0.001	<b>10.0</b>	<b>13.2</b>	<b>12.4</b>	<b>37.8</b>	<b>37.4</b>	<b>37.4</b>
ЦГ	25	1	0.01	10.0	<b>16.9</b>	<b>18.7</b>	<b>40.6</b>	<b>43.3</b>	<b>43.0</b>
ЦГ	25	1	0.05	10.0	<b>32.4</b>	<b>35.4</b>	<b>43.5</b>	<b>56.9</b>	<b>46.1</b>
ЦГ	25	1	0.1	10.0	<b>50.7</b>	<b>52.2</b>	<b>43.1</b>	<b>66.8</b>	<b>40.1</b>

случае вместо  $\delta$ ). Результаты приведены на рис. 1 наряду с результатами численных расчетов (аналогичных тем, что были проведены в [7]), с которыми они находятся в удовлетворительном соответствии.

### Приведенная частота ионизации $\nu$

Рассмотрим потоки ионов в области границы раздела  $i$ - $i$ - и  $e$ - $i$ -плазм. В дальнейших расчетах воспользуемся неразрывностью потоков, т.е. тем, что потоки каждого сорта ионов вблизи границы правее и левее от нее практически одинаковы (рис. 2,  $b$ ).

Нарабатываемый в оболочке и текущий в объем полный поток отрицательных ионов, согласно (1) и (6), есть

$$\Gamma_n \approx -D_{an}^* n_{e0} x_w n(X_0) \frac{\alpha}{\sqrt{\nu + \alpha}},$$

где  $X_0 = 1 - \delta$ . Оценка текущего из объема полного потока положительных ионов, согласно (1), есть

$$\frac{\Gamma_p}{D_{ap}^* n_{e0} x_w} \approx \nu \int_0^{1-\delta} n(X) dX \quad (\text{ПГ})$$

или

$$\frac{\Gamma_p}{D_{ap}^* n_{e0} x_w} \approx \frac{\nu}{1 - \delta} \int_0^{1-\delta} X n(X) dX \quad (\text{ЦГ}).$$

Каждый из этих потоков состоит из дрейфового и диффузионного компонентов (см. (2)).

И полный  $\Gamma_p$ , и диффузионный  $\Gamma_D^p$  потоки положительных ионов к границе формируются в объеме и направлены к стенке. Строго говоря, диффузия ионов из объема, где  $N \approx P \gg n$ , должна проходить по ионно-амбиполярному механизму [1]. Однако коэффициент такой диффузии практически равен коэффициенту униполярной ионной диффузии (отличия, например, для ионов  $O^-$ ,  $O_2^+$  не превышают 28%). Поток  $\Gamma_D^p$  слева от границы

мал, ибо мал градиент концентрации ионов в объеме; последний для  $\alpha \gg 1$  и  $\alpha \gg \beta$  можно оценить из (9) как

$$\frac{dn_p}{dx} \approx -\frac{n_{e0} N_0}{2x_w} \frac{\nu\beta}{\nu + \alpha}, \quad \text{а } \Gamma_D^p \approx \frac{T_i \mu_p}{e} \frac{n_{e0} N_0}{2x_w} \frac{\nu\beta}{\nu + \alpha}.$$

Полный поток отрицательных ионов  $\Gamma_n$  к границе  $i$ - $i$ - и  $e$ - $i$ -плазм формируется в оболочке (правее границы) и направлен вовнутрь плазмы. Но его диффузионная составляющая  $\Gamma_D^n$  направлена к стенке и весьма значительна, ибо определяется большим градиентом концентраций ионов на границе, где при  $\tau \rightarrow 0$   $\frac{dN(X)}{dx} \rightarrow \infty$  [7]. При  $\tau > 0$  приведенный размер области диффузионного размытия границы примерно равен диффузионной длине  $\lambda$ , тогда

$$\left. \frac{dn_n}{dx} \right|_{\tau > 0} \approx -\frac{n_{e0} N_0}{x_w \lambda}, \quad \text{а } \Gamma_D^n \approx \frac{T_i \mu_n}{e} \frac{n_{e0} N_0}{x_w \lambda}.$$

Дрейфовые потоки ионов  $\Gamma_{dr}^p$  и  $\Gamma_{dr}^n$  текут навстречу друг другу в одном и том же поле, а так как на границе  $N \approx P$ , то должно выполняться  $|\Gamma_{dr}^n|/\mu_n \approx \Gamma_{dr}^p/\mu_p$  или  $(|\Gamma_n| + \Gamma_D^n)/\mu_n \approx (\Gamma_p - \Gamma_D^p)/\mu_p$ . При  $\alpha \gg 1$  и  $\alpha \gg \beta$  можно пренебречь  $\Gamma_D^p$  по сравнению с  $\Gamma_D^n$ . Тот факт, что диффузия ионов сильно влияет на полный поток отрицательных ионов и практически не сказывается на потоке положительных, подтверждается в „вычислительном эксперименте“ — рис. 2,  $b$ . В итоге для ПГ получим

$$n(X_0) \frac{\alpha}{\sqrt{\nu + \alpha}} + N_0 \sqrt{\beta\tau} \approx \nu \int_0^{1-\delta} n(X) dX. \quad (19)$$

Преобразовав (19) с учетом (17) при  $\alpha \gg 1$  и  $\alpha \gg \beta$ , можно получить для ПГ

$$\nu \approx \frac{\sqrt{\alpha} + \alpha\lambda}{1 - \lambda(1 - 2\tau)}. \quad (20)$$

Аналогичные выкладки для ЦГ дают

$$\nu \approx 2 \frac{\sqrt{\alpha} + \alpha\lambda}{1 - 2\lambda(1 - 2\tau)}. \quad (21)$$

При  $\tau > 0$  (20) и (21) переходят в (12).

В принципе, как и из соотношений Шоттки для ЭП плазмы, из (20) или из (21) можно оценить  $\nu$  и электронную температуру плазмы ПС ЭО разряда при  $\tau > 0$ . Из сравнения с данными численного моделирования следует, что при  $\tau \leq 2.5\beta/\alpha$  (20) и (21) дают погрешность не более 25% (таблица).

## Заключение

Точность полученных выражений проверена посредством их сравнения с результатами „вычислительного эксперимента“, т.е. с результатами численного решения уравнений (1)–(3). В таблице приведено сравнение для ПГ величин  $\nu$ , рассчитанных по (20) и (21), а также  $N_0$  — по (17) и (16) — с соответствующими величинами, найденными при численном решении системы (1)–(3) (обозначены как  $\nu_{\text{num}}$  и  $N_{0,\text{num}}$  соответственно). Жирным шрифтом в таблице выделены величины, которые должны соответствовать.

Сравнение форм профилей концентраций приведено на рис. 1. Выражения, описывающие формы профилей  $N(X)$  при  $\tau > 0$  — (14) и (15) — оказались более сложными, чем соответствующие выражения (9), приведенные в [7] для  $\tau \rightarrow 0$ . Однако аналитические выражения, полученные в настоящей работе при  $\tau > 0$  для величин  $\nu$  — (20), (21),  $N_0 = N(0)$  — (17) и  $\delta$  — (18), все же оказались явными и в достаточной мере простыми. В пределе  $\tau \rightarrow 0$  они, как и (14) и (15), переходят в полученные ранее соотношения (12), (10), (7) и (9) соответственно. Для  $\tau \leq 2.5\beta/\alpha$  погрешность оценок  $\nu$  и форм профилей не превышает 20–30% в любой геометрии. При использовании (17) погрешность оценки  $N_0 = N(0)$  для ПГ при  $\tau \leq 2.5\beta/\alpha$  не превышает 15%, но для ЦГ при  $\tau > \beta/\alpha$  она может достичь 30–50%. Однако если при этом  $\tau/\beta < 0.16$  (т.е.  $\lambda < 0.4$ ), то для оценки величины  $N_0$  можно использовать формулу (16), хотя и более сложную, чем (17), но дающую погрешность  $N_0$  не более 10%.

## Список литературы

- [1] Цендин Л.Д. // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 1. С. 21–28.
- [2] Volynets V.N., Lukyanova A.V., Rakhimov A.T. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1993. Vol. 26. P. 647–656.
- [3] Ferreira C.M., Gousset G., Touzeau M. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1988. Vol. 21. P. 1403–1413.
- [4] Daniels P.G., Franklin R.N. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1989. Vol. 22. P. 780–785.
- [5] Franklin R.N., Snell J. // J. Phys. D: Appl. Phys. 1994. Vol. 27. P. 2102–2106.
- [6] Головицкий А.П. // ЖТФ. 2011. Т. 81. Вып. 3. С. 45–54.
- [7] Головицкий А.П., Цендин Л.Д. // ЖТФ. 2014. Т. 84. Вып. 3. С. 44–49.
- [8] Богданов Е.А., Колобов В.И., Кудрявцев А.А., Цендин Л.Д. // ЖТФ. 2002. Т. 72. Вып. 8. С. 13–20.
- [9] Богданов Е.А., Кудрявцев А.А., Цендин Л.Д. и др. // ЖТФ. 2003. Т. 73. Вып. 9. С. 70–77.